

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет радіоелектроніки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ХНУРЕ протокол № 5  
від "10" "04" 2018 року

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Ректор ХНУРЕ

"10" "04" 2018 року  
В.В. Семенев



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  
підготовки МАГІСТРА  
Прийом 2018 року

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань 15 Автоматика та приладобудування

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітньо-професійна програма Лазерна і оптоелектронна техніка

Кваліфікація Магістр, Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Лазерна і оптоелектронна техніка

Строк навчання 1 рік 4 місяці

На основі ступіню Бакалавра

Форма навчання денна

Графік навчального процесу

Курс	Вересень				Жовтень				Листопад				Грудень				Січень				Лютий				Березень				Квітень				Травень				Червень				Липень				Серпень										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
1																		::	::	::	=	=	=																::	::	::	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=		
2	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	М	М	М	М	М	М																																					

теоретичне навчання

екзаменаційна сесія

канікули

практична підготовка

атестація

атестаційна робота

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (прийм 2018 р.)																													
N пп	НАЗВА ДИСЦИПЛІН	Семестровий контроль		контрольні роботи, РГЗ	курсове проектування	ECTS Кредити (1 кр = 30 год.)	Години										кількість тижнів												кафедра
		екзамени	заліки				всього годин	Аудиторні					Самостійна робота					1 курс				2 курс							
								всього	лекції	практичн. заняття	лаборат. роботи	орні роботи	Консультації	всього	Над. інд. Завдан.	Над. дисц.	1	2	3	лк	пз	лб	конс	лк	пз	лб	конс		
		цикл загальної та спеціальної (фахової) підготовки												17				17				15							
		Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)												17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
<b>ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ</b>																													
<b>Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)</b>																													
1	Інтелектуальна власність		2			3	90	36	18	12		6	54							18	12		6						ІІІ
2	Ділова іноземна мова		2			3	90	36	18	12		6	54							18	12		6						ІІ.мов
3	Філософські проблеми наукового пізнання		2			3	90	36	18	12		6	54							18	12		6						Філ.
4	Педагогіка вищої школи		2			3	90	36	18	12		6	54							18	12		6						Філ.
5	Економічне обґрунтування проєктів		2			3	90	36	18	12		6	54							18	12		6						ЕК
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1</b>			<b>3</b>	<b>90</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>12</b>		<b>6</b>	<b>54</b>							<b>18</b>	<b>12</b>		<b>6</b>						
6	Фізичне виховання (за рахунок вільного часу студентів)		1																										Фізвих.
<b>Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов'язкові)</b>																													
7	Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право		1			4	120	48	24	16		8	72			24	16		8										ФЛІ
8	Державні еталони України	1				5	150	60	30	20		10	90			30	20		10										ФЛІ
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>9</b>	<b>270</b>	<b>108</b>	<b>54</b>	<b>36</b>		<b>18</b>	<b>162</b>			<b>54</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>18</b>										
9	Науково-дослідна практика		3			15	450						450																ФЛІ
10	Атестаційна робота (проєкт)	3				15	450						450																ФЛІ
	<b>РАЗОМ (цикл загальної та спеціальної (фахової) підготовки)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>42</b>	<b>1260</b>	<b>144</b>	<b>72</b>	<b>48</b>		<b>24</b>	<b>1116</b>			<b>54</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>18</b>										
<b>ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ</b>																													
<b>Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою Лазерна і оптикоелектронна техніка (обов'язкові)</b>																													
9	Нанопотоніка	1				6	180	72	36	12	12	12	108			36	12	12	12										ФЛІ
10	Оптичні інформаційні системи		1		ІКП	5	150	60	30	16	4	10	90			30	16	4	10										ФЛІ
11	Лазерна прикладна спектроскопія	1				5	150	60	30	16	4	10	90			30	16	4	10										ФЛІ
12	Лазерні технології обробки матеріалів		1			5	150	60	30	16	4	10	90			30	16	4	10										ФЛІ
13	Недифракційна прикладна оптика	2				7	210	84	42	24	4	14	126							42	24	4	14						ФЛІ
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>28</b>	<b>840</b>	<b>336</b>	<b>168</b>	<b>84</b>	<b>28</b>	<b>56</b>	<b>504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>14</b>						
<b>Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою Лазерна і оптикоелектронна техніка (вибіркові)</b>																													
14.1	Комп'ютерна фотоніка		2			7	210	84	42	24	4	14	126							42	24	4	14						ФЛІ
14.2	Квантова оптикоінформатика і оптичні комп'ютери		2			7	210	84	42	24	4	14	126							42	24	4	14						ФЛІ
15.1	Наноматеріали і взаємодія з оптичним випромінюванням	2				5	150	60	30	16	4	10	90							30	16	4	10						ФЛІ
15.2	Наноматеріали і нанотехнології	2				5	150	60	30	16	4	10	90							30	16	4	10						ФЛІ
16.1	Світлодіодні технології	2				4	120	48	24	12	4	8	72							24	12	4	8						ФЛІ
16.2	Сучасні оптичні прилади	2				4	120	48	24	12	4	8	72							24	12	4	8						ФЛІ
17.1	Фізика оптоволоконних систем		2			4	120	48	24	12	4	8	72							24	12	4	8						ФЛІ
17.2	Оптичні властивості матеріалів		2			4	120	48	24	12	4	8	72							24	12	4	8						ФЛІ
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>20</b>	<b>600</b>	<b>240</b>	<b>120</b>	<b>64</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>64</b>	<b>16</b>	<b>40</b>						

РАЗОМ (цикл професійної підготовки)					48	1440	576	288	148	44	96	864	0	0	126	60	24	42	162	88	20	54									
РАЗОМ (обов'язкові компоненти)					67	2010	444	222	120	28	74	1566	0	0	180	96	24	60	42	24	4	14									
кредитів у семестрі																															
РАЗОМ (вибіркові компоненти)					23	690	276	138	76	16	46	414	0	0	0	0	0	0	138	76	16	46									
кредитів у семестрі																															
<b>ВСЬОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА</b>					<b>90</b>	<b>2700</b>	<b>720</b>	<b>360</b>	<b>196</b>	<b>44</b>	<b>120</b>	<b>1980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>96</b>	<b>24</b>	<b>60</b>	<b>180</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>60</b>									
кредитів у семестрі																															
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН															360	360														
	КІЛЬКІСТЬ АУДИТОРНИХ ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ															21,18	20,00														
	Кількість іспитів															3	3														
	Кількість заліків															3	3														
	Кількість курсових проектів і робіт															1															
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН															<b>360</b>	<b>360</b>														
	КІЛЬКІСТЬ АУДИТОРНИХ ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ															21,18	20,00														
	Кількість іспитів															3	3														
	Кількість заліків															3	3														
	Кількість курсових проектів і робіт															1															

Навчальний план розроблено на основі освітньо-професійної програми  
Лазерна і оптоелектронна техніка  
за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  
для другого (магістерського) рівня освіти

Узгоджено на Раді факультету ЕЛБІ протокл № 8 від 21.03.2018 р.

УЗГОДЖЕНО

Проректор з НМР  І.В. Рубан

Керівник ОМЦ  І.В. Магдаліна

Начальник НВ  А.В. Міхнова

Керівник проектної групи  
за спеціальністю 152 Метрологія та  
інформаційно-вимірювальна техніка

Декан факультету ЕЛБІ

Зав. кафедри ФЛІ





Є.М. Одаренко

А.В. Васянович

Ю.П. Мачехін